PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000221105 A

(43) Date of publication of application: 11.08.00

(51) Int. CI

G01M 11/00 // G02B 6/24

(21) Application number: 11020778

(22) Date of filing: 28.01.99

(71) Applicant:

FUJIKURA LTD

(72) Inventor:

SUZUKI ISAO

(54) APPARATUS FOR INSPECTING END SURFACE OF OPTICAL FIBER AND METHOD THEREFOR

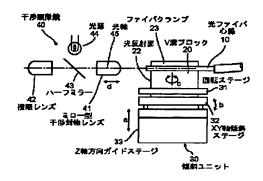
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the operation for setting an optical fiber axis in parallel with an optical axis of an interference microscope, when an end surface of the optical fiber is to be observed with the interference microscope.

SOLUTION: A side face orthogonal to a V-groove where a coated optical fiber 10 of a V-groove block 20 is set as a light reflecting face 22, precisely vertical to the length direction of the V-groove, and the V-groove block 20 is placed on an inclined unit 30, capable of inclining in each direction of three axes orthogonal each other. An interference microscope 40 is disposed at a side of the tip face of the coated fiber 10 set at the V-groove of the block 20, and on the side of a light reflecting face 22 of the block 20, and the face 22 is observed, and an inclination for each direction is determined by adjusting the inclined unit 30 so as not to produce an interference fringe. By adjusting the image of the face 22 so as not to produce the fringe, the

face 22 becomes precisely vertical with respect to a light axis 15 of the microscope 40, and an axis of the coated fiber 10 have been adjusted precisely in parallel with the optical axis 45.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山銀公開登号 特開2000-221105 (P2000-221105A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) Int.CL'		織別記号	FI			ラーマコード(参考)
G01M	11/00		G01M	11/00	G	2G086
# G02B	6/24		G 0 2 B	6/24		2H036

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

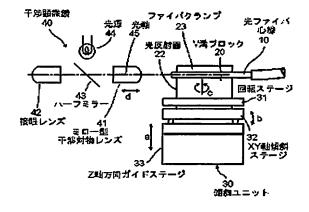
(21)出顧番号	特顧平11-20778	(71)出顧人 000005186		
		株式会社フジクラ		
(22)出額日	平成11年1月28日(1999.1.28)	東京都江東区木場1丁目5番1号		
		(72) 発明者 鈴木 功		
		千葉県佐倉市大崎1440番地株式会社フジク		
		ラ佐倉工場内		
		(74)代理人 100075122		
		弁理士 佐聯 祐介		
		Fターム(参考) 20088 AAG4		
		29038 KAOO KAO1 KAO3 LAO3		

(54) 【発明の名称】 光ファイバ端間検査装置および方法

(57)【要約】

【課題】 干渉顕微鏡により光ファイバ蟾面を観察する 際のその光ファイバ輪を干渉顕微鏡の光輪に平行にセッ トする作業を容易化する。

【解決手段】 V漢ブロック20の光ファイバ心線10がセットされるV漢に直交する側面を、そのV溝の長さ方向に精密に垂直な光反射面22として形成し、このV溝でロック20を直交3軸の各方向に傾斜可能な傾斜ユニット30上に設置する。V漢ブロック20のV溝にセットされる光ファイバ心線10の先端面およびV溝ブロック20の光反射面22の側に干渉開敞鏡40を配し、これにより光反射面22を観察し、干渉縞が生じないように傾斜ユニット30を調整して各方向の傾斜を定める。光反射面22の画像において干渉縞が生じないように調整できれば、光反射面22が干渉開敞鏡40の光軸45に対して精密に直角になり、光ファイバ心線10の軸が光輪45に精密に平行になるよう調整できたことになる。



[0006]

特闘2000-221105

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に被額察光ファイバをセットするためのV海が形成され、かつそのV海の長さ方向に垂直な光反射面とされた側面が形成されているV海ブロックと、該V海ブロックを直交3萬方向に傾斜可能に保持する傾斜ユニットと、上記V溝ブロックの光反射面とされた側面方向に配置される干渉頻敞鏡とを備えることを特徴とする光ファイバ端面検査装置。

1

【請求項2】 表面に被額察光ファイバをセットするためのソ海が形成され、かつそのソ海の長さ方向に垂直な 10 光反射面とされた側面が形成されているソ海ブロックを、傾斜ユニットにより直交3軸方向に傾斜可能に保持し、干渉顕微鏡によって上記ソ海ブロックの光反射面とされた側面を観察しながら、傾斜ユニットの傾きを調整した後、上記のソ海にセットされた被観察光ファイバの端面を干渉顕微鏡で観察することを特徴とする光ファイバ端面検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、光ファイバの切 20 断端面が軸に対して直角になっているかあるいは凹凸が あるか等の端面の状態を検査する装置および方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】光ファイバを付き合わせ接続するような 場合、端面が軸に対して直角でかつ鏡面になっている必 要がある。光ファイバ切断装置は、上記のような端面が 得られるように光ファイバを切断するものであり、つね に良好な鑑面が得られることが保証されていなければな ちない。そこで、光ファイバ切断装置の製造工程におい 30 て、実際にその切断装置で光ファイバを切断してみて、 その切断状況の良否を判定することで、その光ファイバ 切断装置そのものの最終的なチェックを行っている。光 ファイバ端面検査装置はこのような用途に用いられる。 【0003】従来の光ファイバ端面検査装置は、マイケ ルソン干渉計やミロー型干渉対物レンズを用いた干渉顕 微鏡により構成されているが、いずれにしても、光軸に 対して基準面を正確に垂直にセットする必要があり、そ の上で、基準面と試料面との距離的差異に応じて干渉縞 を発生させるものである。すなわち、この光ファイバ端 40 面検査装置によって光ファイバの切断端面の状態(切断 角度など)を観察しようとすれば、光ファイバ軸が干渉 顕微鏡の光軸に正確に平行となるように被観察光ファイ バをセットする必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 光ファイバ蟾面検査装置では、彼観察光ファイバの軸を 光軸に対して厳密に平行にセットすることは難しく、そ の調整に非常に多くの手間をかける必要があり、またそ の作業者には経験も要求される。 【0005】との発明は、上記に鑑み、比較的簡単な構成で、被観察光ファイバの軸を光軸に対して厳密に平行にセットすることを、経験の浅い作業者でも容易に行うことができるように改善した、光ファイバ端面検査装置および方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、この発明による光ファイバ蟾面鏡査装置においては、表面に絨質深光ファイバをセットするためのV滞が形成され、かつそのV滞の長さ方向に垂直な光反射面とされた側面が形成されているV滞ブロックと、該V滞ブロックを直交3軸方向に傾斜可能に保持する傾斜ユニットと、上記V滞ブロックの光反射面とされた側面方向に配置される干渉顕微鏡とが備えられることが特徴となっている。

[0007]また、この発明による光ファイバ端面検査 方法では、衰面に被観察光ファイバをセットするための ソ溝が形成され、かつそのソ溝の長さ方向に垂直な光反 射面とされた側面が形成されているソ溝ブロックを、傾 斜ユニットにより直交3軸方向に傾斜可能に保持し、干 秒頭微鏡によって上記V溝ブロックの光反射面とされた 側面を観察しながら、傾斜ユニットの傾きを調整した 後、上記のV溝にセットされた被観察光ファイバの端面 を干渉顕微鏡で観察することが特徴となっている。

【①①①8】 V 溝ブロックは、直交3 軸方向に傾斜可能な傾斜ユニットにより保持されているので、あらゆる方向に傾けることができる。この V 溝ブロックの、光反射面とされた側面の方向には干渉顕微鏡が配置される。干渉顕微鏡で、この側面を観察しながら、干渉結が発生しないように傾斜ユニットの傾きを調整することにより、その顕微鏡の光軸に対してその側面が正確に直角となるよう調整することが容易にできる。この側面は V 溝の長さ方向に垂直に形成されているので、 V 溝に被観察光ファイバを直角つまり顕微鏡の光軸に対して正確に平行となる。そのため、被観察光ファイバの端面により生じる干渉る。そのため、被観察光ファイバの端面により生じる干渉るを干渉顕微鏡で観察することによって、その端面の光ファイバ軸に対する角度やその端面に生じた凹凸状態の検査が可能になる。

0 [0009]

【発明の実施の形態】つぎに、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図1に示すように、紋観測光ファイバである光ファイバ心線(の紋環が剥離された部分)10がV滞ブロック20に、ファイバクランブ23によってクランブされるようになっている。つまり、このV滞ブロック20には、図2に示すようにV滞21が形成されていて、そのV滞21に入るように光ファイバ心線10がセットされる。そして、このV潜ブロック20のV滞21の長さ方向に直角な側面50 22は光反射面とされている。この側面22に、たとえ

(3)

は照明光を反射するような表面処理が絡されたり、あるいは反射型平行オプティカルフラットが貼り合わされることにより光反射面とされている。この光反射面22は、V滞21の長さ方向に対して厳密に垂直となるように結密加工される。

3

【0010】このV港ブロック20は、傾斜ユニット3 0により保持される。この傾斜ユニット30はあらゆる 方向。つまり直交3軸をX、Y,2(債、縦、高さ)と したときその各軸の回り方向に傾斜させられるようになっているとともに、高さ方向(2方向)へ移動できるようにされている。すなわち、V港ブロック20はまず回転ステージ31は矢印でに示すように2軸の回りに回転できるようになっている。この回転ステージはXY軸傾斜ステージ32上に載せられている。このXY軸傾斜ステージ32は、矢印りに示すようにX軸回りとといそれぞれ独立に傾斜できるようにされたものである。このX Y傾斜ステージ32は2軸方向ガイドステージ33により2方向(矢印a方向)に移動できるように保持される。

【0011】XY輔傾斜ステージ32はたとえば図3の ように構成されている。とこではその1軸回り方向の傾 斜を可能とする機構のみを示す。基合51の上に傾斜台 52を置き、基合51の上面の一端に設けた支点53で 支持して、この支点5.3を中心にして、つまり図の支点 53における紙面に直角な軸の回りに、回転できるよう にする。この傾斜台52に軸止されたレバー55を、基 台51中央のスプリング収納孔56に収納されたスプリ ング54で引っ張ることにより傾斜台52を基台51側 へ、つまり図の時計回り方向に付勢する。基台51の他 30 蜷側には調整ネジ57が設けられていて、この先端に傾 斜台52が突き当たるようにされる。この調整ネジ57 を回してその先端の突出量を調整することにより、傾斜 角度の調整ができる。支点53における回転輪をX輪と 平行とするなら、これの下(または上)に同様な機構 を、その支点軸がY軸と平行になるように重ね合わせる ことにより、X軸回りとY軸回りとにそれぞれ独立に領 斜できることになる。

【0012】 V潜ブロック20のV滞21にセットされた光ファイバ心線10の先端方向つまり V滞ブロック2 40 0の光反射面22側には、干渉顕微鏡40が配置される。ここでは干渉顕微鏡40は、ミロー型干渉対物レンズにより構成されたものを用いているが、他のタイプの干渉顕微鏡でもよいことはもちろんである。この干渉顕微鏡40は、光軸45上にミロー型干渉対物レンズ41と接眼レンズ42とを有するとともに、その間にハーフミラー43を備え、光源44からの光を導入するようにしている。ミロー型干渉対物レンズ41は光輪41方向に矢印はに示すように移動してフォーカス調整ができるようにされている。 50

【0013】とこで、干渉顕微鏡40が光ファイバ心線10の先端の端面を観察するように設置されており、V 滞ブロック20におけるこの先端側の側面は光反射面2 2とされているため、その光反射面22も、干渉顕微鏡40の視野内に入ることになる。そこで、この干渉顕微鏡40によって観察することにより光反射面22につき干渉縮が生じていないかどうかを観察する。この観察を行いながら、XY傾斜ステージ32および回転ステージ31を調整してX、Y、Zの3軸の各々について傾斜角度の調整を行う。干渉縞が生じないように調整できれば、光反射面22が干渉顕微鏡40の光輪45に結密に直角にセットされたことになる。

【0014】とのことは、V滞21の長さ方向が干渉顕 機鏡40の光軸45に精密に平行にセットされたことを 意味する。このような調整ができた後、2軸方向ガイド ステージ33により矢印a方向に移動し、光ファイバ心 線10の先端の端面が干渉顕微鏡40の視野中心に位置 するように調整し、この端面の観察を行う。この端面が 光ファイバ心線10の軸に直角で鏡面状であるなら、平 移稿は発生しない。ところが、端面が直角でなかった り、完全にフラットでなくて凹凸があるようなら、干渉 縞が発生し、その角度や凹凸状態を知ることが可能となる。

【①①15】なお、上記はこの発明の一つの実施の形態

に関して説明したものであり、具体的な構造などはこの 発明の趣旨を逸脱しない範囲で程々に変更できることは 雪うまでもないことであろう。すなわち、V海ブロック 20を直交3軸方向に傾斜可能に保持する傾斜ユニット 30の構造は図示のものに限らない。干渉顕微鏡40に ついても他のタイプのものを使用することができる。 【0016】また、V揚ブロック20の側面22は、V 滞の長さ方向に正確に垂直な光反射面であればどのよう なものでもよい。この光反射面とされた側面22に代わ るものとして、図4に示すようなゲージ25の端面26 を用いてもよい。このゲージ25は、石英ガラスあるい はスチールなどで被観測光ファイバである光ファイバ心 線 1 () と同様な形状の円柱形に作成されており、その端 面26が円柱の中心軸に高精度に直角に形成されてい る。そして、この磐面26は、高精度に平坦な鏡面に加 工されることが望ましい。

【0017】このゲージ25を測定される光ファイバ心線10が配置されるV滞21あるいはこれと高額度に平行に形成されたV滞24に配置して、その端面26を干渉顕微鏡40で観察して干渉縞が生じないように傾斜ユニット30を調整する。こうして、端面26が干渉顕微鏡40の光軸45に精密に直角にセットされた状態に調整できる。すると、V滞24とV滞21とは精密に平行とされているので、V滞21の長さ方向が干渉顕微鏡40の光輪45に精密に平行にセットされたことになる。50そのため、このV滞21に配置された光ファイバ心線1

(4)

特闘2000-221105 õ

0の協面を干渉顕微鏡で観察してその縞模様により端面 の品質を検査することができる。1つのV達21に最初 ゲージ25を配置して上記の調整を行った後、観測すべ き光ファイバ心線10に置き換えるようにすれば、この V溝21と平行なV溝24を作っておく必要はなくな る。

5

[0018]

【発明の効果】以上説明したように、この発明による光 ファイバ端面検査装置および方法によれば、観察すべき 光ファイバ蝶面と同じ側にあるV澤ブロック側面を、V 海の長さ方向に直角な光反射面としているので、このV 漢ブロック側面を干渉顕敞鏡で観察してその干渉縞によ りとの側面を干渉顕微鏡の光輪に直角なものとする調整 を容易に行うことができる。このことは、V漢の長さ方 向つまり又様にセットされる光ファイバの軸を干渉顕微 鏡の光輪に平行なものとする調整が容易に行えるととを 意味する。これにより、経験の浅い作業者でも容易に光 ファイバ端面の検査が行えるようになる。しかも装置の 構成としても比較的簡単な構成となっている。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の実施の形態を示す模式図。
- 【図2】同実施の形態におけるV海ブロックを示す模式 的な斜視図。
- 【図3】同実施の形態におけるXY傾斜ステージの例を 模式的に示す断面図。
- 【図4】変形例におけるV溝ブロック部分を示す模式的*

*な斜視図。

【符号の説明】

- 光ファイバ心線 10 V海ブロック 20
- 21.24 V海
- 22 光反射面
- 23 ファイバクランプ
- 25 ゲージ
- 26
- ゲージの協面 30 傾斜ユニット
- 31 回転ステージ
- 32 XY軸傾斜ステージ
- 33 2輪方向ガイドステージ
- 40 干涉顕微鏡
- ミロー型干渉対物レンズ 41
- 42 接眼レンズ
- ハーフミラー 43
 - 光源
- 45 光軸

44

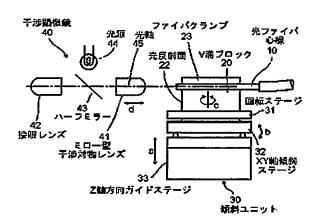
57

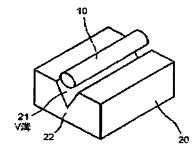
20

- 51 基台
- 52 傾斜台
- 53 支点
- 54 スプリング
- 55 1/25-
- 56 スプリング収納孔
 - 調整ネジ

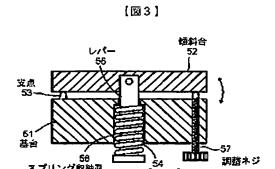
[図1]

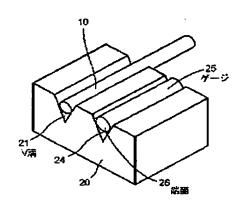
[図2]





特闘2000-221105





[図4]